

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เนื่องจากความต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กลงมากรา และมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ดังนั้นวัสดุไดอิเล็กตริกที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกสูงจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญทางด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากว่าวัสดุเหล่านี้สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญต่างๆ ดังเช่น ตัวเก็บประจุ (capacitor) และสิ่งประดิษฐ์ความจำ (memory device) โดยค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของวัสดุจะเป็นปัจจัยหลักในการลดขนาดและคงประสิทธิภาพของอุปกรณ์เหล่านี้ได้ โดยที่ว่าวัสดุที่มีค่าไดอิเล็กตริกสูงหรือที่เรียกว่า “ใจแอนท์ไดอิเล็กตริก” จะมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันแต่ที่ได้รับความสนใจและทำการศึกษา กันอย่างต่อเนื่อง คือ วัสดุ แคลเซียมคอปเปอร์ไททาเนต ( $\text{CaCu}_3\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ , CCTO) [1], นิกелиออกไซด์เจือลิเทียมไททาเนียม ( $\text{Li}_x\text{Ti}_y\text{Ni}_{1-x-y}\text{O}$ , LTNO) [2, 3] และคอปเปอร์ออกไซด์ ( $\text{CuO}$ ) [4, 5] ในบรรดา วัสดุใจแอนท์ไดอิเล็กตริกที่ได้กล่าวถึงมาแล้วนั้น CCTO เป็นวัสดุใจแอนท์ไดอิเล็กตริกที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษและมีรายงานการวิจัยอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีโครงสร้างแบบเพอร์อฟส์ไกท์ มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกสูงมาก ประมาณ  $10^4$  (ที่อุณหภูมิห้องและในช่วงค่าความถี่ต่ำกว่า 1 กิโลเฮิรตซ์) และที่สำคัญค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของ CCTO มีค่าค่อนข้างคงที่ตลอดช่วงอุณหภูมิ  $173\text{--}325^\circ\text{C}$  ตามรายงานการวิจัยครั้งแรกโดยกลุ่มของ Subramanian (2000) [1] นอกจากนี้ CCTO ยังเป็นวัสดุที่ไม่มี ตะกั่วเป็นองค์ประกอบ (lead-free) จากคุณสมบัติทางไดอิเล็กตริกที่เป็นเลิศดังกล่าวที่ทำให้ CCTO เป็นวัสดุไดอิเล็กตริกที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งในด้านของการวิจัยพื้นฐานและการนำไป ประยุกต์ใช้งาน [6] อย่างไรก็ตามจากการรายงานการวิจัยเกี่ยวกับวัสดุ CCTO ที่ผ่านมาพบว่า ค่า แทนเจนต์การสูญเสีย ( $\tan\delta$ ) ของวัสดุ CCTO ที่เตรียมได้ยังมีค่าที่สูงอยู่มากประมาณ 0.20-0.40 ซึ่ง ไม่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้งานจริง ในอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งค่าแทนเจนต์การสูญเสีย ต้องน้อยกว่า 0.05 จากรายงานการวิจัยที่ผ่านมาการศึกษาผลของการเติมสารเจือต่อค่าคงที่ไดอิเล็ก ตริกและค่าแทนเจนต์การสูญเสีย ( $\tan\delta$ ) ในวัสดุ CCTO ส่วนใหญ่ เป็นการเตรียม ด้วยวิธีปฏิกิริยา แบบของแข็งซึ่งต้องใช้อุณหภูมิในการเผาพนัก (calcined) สูง และใช้เวลาในการเตรียมนานมาก เพื่อให้สารเจือเข้าไปแทนที่องค์ประกอบหลักของ CCTO อีกทั้งยังการเตรียมวัสดุ CCTO ด้วยวิธี สารละลายยังไม่มากนัก [10-11] และเมื่อไม่นานมานี้มีรายงานการศึกษาผลของการเติมสารเจือ ในตำแหน่ง ของ ไททาเนียม (Ti) และตำแหน่งของ แคลเซียม (Ca) จากรายงานการวิจัยที่ผ่านมาจะเห็นว่าการ เจือสารเข้าไปในตำแหน่งของ Ti นั้นทำให้ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกนั้นมีค่ามากขึ้น และขึ้นอยู่กับขนาด

ของเกรน ส่วนสารที่เจือเข้าไปในตัวแหน่ง Ca นั้นทำให้ค่าแทนเจนต์การสูญเสีย ( $\tan\delta$ ) นั้นลดลง เนื่องจากสารเจือที่เข้าไปนั้นเข้าไปเพิ่มความต้านทานให้กับขอบเกรน

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อเตรียมผงวัสดุ CCTO โดยการเพิ่มปริมาณ Ti จากองค์ประกอบเดิมเป็น Ca:Cu:Ti:O เป็น 1:3:4 (CCTO) เป็น 1:3:4.35 (CCT<sub>0.35</sub>O) และเตรียม CCT<sub>0.35</sub>O เจือด้วย Pr, Sr และ Sn ที่ตำแหน่ง Ca และ Ti ในปริมาณ 0.00, 0.03 และ 0.06 เปอร์เซนต์โดยโมล โดยวิธีโพลิเมอร์ไฟโรไรซีส (Polymer pyrolysis method) ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของผลที่เตรียมได้ด้วยเทคนิค การเลี้ยวเบนด้วยรังสีเอกซ์ (X-rays diffraction, XRD), ศึกษาโครงสร้างของผงวัสดุที่เตรียมได้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กtronแบบทรา�สมิสชัน (Transmission Electron Microscopy, TEM), ศึกษาภาพถ่ายเชิงลึกด้วย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscopy, SEM-EDX) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าคงที่ไดอิเล็กตริกและค่าแทนเจนต์การสูญเสีย ( $\tan\delta$ ) ของวัสดุ CCT<sub>0.35</sub>O และวัสดุ CCT<sub>0.35</sub>O ที่เจือด้วย Sr, Pr และ Sn ที่อุณหภูมิห้อง และศึกษาสมบัติความไม่เป็นเชิงเส้นระหว่างกระแสและความต่างศักย์ (Non linear Properties) ของวัสดุที่เตรียมได้

## 2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

2.1 เตรียมผงวัสดุ CCT<sub>0.35</sub>O และ CCT<sub>0.35</sub>O เจือด้วย Pr (CPrCT<sub>0.35</sub>O), Sr (CSrCT<sub>0.35</sub>O), Sn (CCT<sub>0.35</sub>SnO) โดยวิธีสารละลายโพลิเมอร์ไฟโรไรซีส

2.2 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของผงและวัสดุด้วย เทคนิค XRD, TEM-EDS และศึกษาภาพถ่ายด้วยเทคนิค SEM-EDS

2.3 ศึกษาผลของ Ti ที่เพิ่มขึ้นและผลของสารเจือ Pr, Sr และ Sn ต่อค่าคงที่ไดอิเล็กตริก และค่า  $\tan\delta$

2.4 ศึกษาผลของ Ti ที่เพิ่มขึ้นและผลของสารเจือ Pr, Sr และ Sn ต่อความไม่เป็นเชิงเส้นระหว่างค่ากระแสและความต่างศักย์ (I-V curve) ในวัสดุที่เตรียมได้

## 3. ขอบเขตของโครงการวิจัย

3.1 เตรียมผงวัสดุ CCT<sub>0.35</sub>O และ CCT<sub>0.35</sub>O เจือด้วย Pr (CPrCT<sub>0.35</sub>O), Sr (CSrCT<sub>0.35</sub>O), Sn (CCT<sub>0.35</sub>SnO) โดยวิธีสารละลายโพลิเมอร์ไฟโรไรซีส

3.2 เผาแคลไซด์ผงวัสดุ CCT<sub>0.35</sub>O, CPrCT<sub>0.35</sub>O, CSrCT<sub>0.35</sub>O และ CCT<sub>0.35</sub>SnO ที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส (°C) โดยใช้เวลา 9 ชั่วโมง (h)

3.3 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของเม็ดและผงวัสดุที่เตรียมได้ด้วยเทคนิค XRD, TEM-EDS และ SEM-EDS

3.4 เตรียมเม็ดวัสดุ  $\text{CCT}_{0.35}\text{O}$ ,  $\text{CPrCT}_{0.35}\text{O}$ ,  $\text{CSrCT}_{0.35}\text{O}$  และ  $\text{CCT}_{0.35}\text{SnO}$  และเผาผนึก (sintered) ที่อุณหภูมิ 1060 องศาเซลเซียส ( $^{\circ}\text{C}$ ) โดยใช้เวลา 6 และ 10 ชั่วโมง (h)

3.5 ศึกษาผลการเปลี่ยนค่าคงที่ไดอิเล็กทริก ค่าการสูญเสีย ( $\tan\delta$ ) ที่อุณหภูมิห้อง และความถี่ 100 Hz-1 MHz

3.6 ศึกษาผลความไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear current voltage) ในวัสดุที่เตรียมได้

#### 4. นิยามศัพท์

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงผลของเวลาที่มีผลต่อคุณสมบัติทางไฟฟ้า ดังนั้น จึงมีนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยดังนี้

สัญลักษณ์	ความหมาย (ไทย)	ความหมาย (อังกฤษ)
$A$	พื้นที่หน้าตัดแผ่นเพลต	The plate capacitor of area
$Z^*$	ออมพิเดนซ์เชิงซ้อน	The complex impedance
$Z'$	ส่วนจริงของออมพิเดนซ์	The real part of complex impedance
$Z''$	ส่วนจินตภาพของออมพิเดนซ์	The imaginary part of complex impedance
$\beta$	ความกว้างที่ครึ่งหนึ่งของความสูง	The full width at half maximum
$\beta_o$	ความกว้างที่ครึ่งหนึ่งจาก X-ray	The widths from the observed X-ray
$\beta_i$	ความกว้างที่ครึ่งหนึ่งจากการวัด	The width due to instrumental effects
$C^*$	ค่าปาราซิเทนเชิงซ้อน	The complex capacitance
$C_g$	ค่าปาราซิเทนส่วนเกรน	The grain capacitance
$C_{gb}$	ค่าปาราซิเทนส่วนขอบเกรน	The grain boundary capacitance
$C_o$	ค่าปาราซิเทนสูญญากาศ	The vacuum capacitance
$D$	ขนาดผลึก	The crystallite size
$d_{hkl}$	ระยะห่างระหว่างระนาบ	The d-spacing
$\vec{E}$	สนามไฟฟ้า	The electric field
$E_a$	พลังงานกระตุ้น	The activation energy
$\epsilon^*$	สภาพะยอมไฟฟ้าเชิงซ้อน	The complex permittivity
$\epsilon'$	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก	The dielectric constant
$\epsilon''$	ค่าสูญเสียไดอิเล็กทริก	The dielectric loss
$\epsilon_0$	ค่าสภาพะยอมของสูญญากาศ	The permittivity of free space $(8.8542 \times 10^{-14} \text{ F.cm}^{-1})$
$d_s$	ความหนาของตัวอย่าง	The thickness of the sample

$I$	กระแสไฟฟ้า	The current
$k$	ค่าคงที่ของโบลซ์มาน	The Boltzmann constant $(1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K})$
$R_{gb}$	ความต้านทานขอบเกรน	The grain boundary resistance
$R_g$	ความต้านทานเกรน	The gain resistance
$\sigma$	ค่าสภาพนำไฟฟ้า	The conductivity
$\alpha$	สัมประสิทธิ์ความเป็นเชิงเส้น	The nonlinear coefficient
$T$	อุณหภูมิสัมบูรณ์	Temperature (Kelvin)
$t$	เวลา	Time
$\tan \delta$	ค่าเทนเจนต์การสูญเสีย	The dielectric loss tangent
$\tau$	เวลาที่เกิดการผ่อนคลาย	The relaxation time

## 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ผลของการเปลี่ยนแปลงปริมาณ Ti ต่อ ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก ค่า  $\tan \delta$  อนโนห์มมิค และค่าความต้านทาน

5.2 ผลของสารเจือ Pr, Sr และ Sn ต่อ ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก ค่า  $\tan \delta$  อนโนห์มมิค และค่าความต้านทาน

5.3 เป็นองค์ความรู้ในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับวัสดุไดอิเล็กทริกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.4 นำเสนอหรือตีพิมพ์งานวิจัยระดับชาติ หรือนานาชาติ

5.5 เป็นการสร้างชื่อเสียงด้านการวิจัย ให้กับมหาวิทยาลัยฯ